

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第1区分

【発行日】平成21年11月26日(2009.11.26)

【公開番号】特開2007-127649(P2007-127649A)

【公開日】平成19年5月24日(2007.5.24)

【年通号数】公開・登録公報2007-019

【出願番号】特願2006-298575(P2006-298575)

【国際特許分類】

G 0 1 D 5/38 (2006.01)

【 F I 】

G 0 1 D 5/38 Z

【手続補正書】

【提出日】平成21年10月7日(2009.10.7)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

スケール(11~15)と担持体(51~55)の間で接合結合部を製造することにより、担持体(51~55)にスケール(11~15)を固定するための方法において、
接合結合が二次元パターンで配分された状態で設けられており、互いに間隔をおいて設けられた多数のスケール(11~15)の表面領域(61~65)で行われており、これらの表面領域が各々管路(200)により互いに分離していることを特徴とする方法。

【請求項2】

接合結合が直接接合、低温接合あるいは陽極接合により行われることを特徴とする請求項1記載の方法。

【請求項3】

表面領域(61~65)が隆起部(31~35)により形成され、これらの隆起部がスケール(11~15)の厚さよりもごくわずかしかない相互間隔を備えていることを特徴とする請求項1または2に記載の方法。

【請求項4】

接合結合に加えて別の結合が実施されることを特徴とする請求項1~3のいずれか一つに記載の方法。

【請求項5】

スケールを備えた担持体であって、この場合スケール(11~15)が担持体(51~55)において接合により固定されている担持体において、

接合が二次元パターンで配分された状態で設けられており、互いに間隔をおいて設けられた多数のスケール(11~15)の表面領域(61~65)で行われており、これらの表面領域が各々管路(200)により互いに分離していることを特徴とする担持体。

【請求項6】

スケール(11~15)および/または担持体(51~55)に隆起部(31~35)が形成されており、この隆起部が互いに間隔をおいて設けられた表面領域(61~65)を形成していることを特徴とする請求項5記載の担持体。

【請求項7】

表面領域(61~65)が隆起部(31~35)により形成され、これらの隆起部がスケール(11~15)の厚さよりもごくわずかしかない相互間隔を備えていることを特徴と

する請求項 5 記載の担持体。

【請求項 8】

接合結合に加えて別の結合部が設けられていることを特徴とする請求項 5 ~ 7 のいずれか一つに記載の担持体。

【請求項 9】

担持体 (5 , 5 0) に固定するための固定面を備えたスケールにおいて、

固定面が二次元パターンで配分された状態で設けられており、互いに間隔をおいて設けられた隆起部 (3 , 3 0) により形成されており、この場合隆起部 (3 , 3 0) が各々、担持体 (5 , 5 0) の対向面 (4 , 4 0) と接合結合を作るための接合可能な表面 (6 , 6 0) を備えていることを特徴とするスケール。

【請求項 10】

表面領域 (6 1 ~ 6 5) が隆起部 (3 1 ~ 3 5) により形成され、これらの隆起部がスケール (1 1 ~ 1 5) の厚さよりもごくわずかしかない相互間隔を備えていることを特徴とする請求項 9 記載のスケール。